

課題番号 : F-15-IT0033  
利用形態 : 技術相談  
支援課題名 (日本語) : SiO<sub>2</sub> 上金属微細パターンの作製  
Program Title (in English) : Metal disc on SiO<sub>2</sub>  
利用者名 (日本語) : 三宮 工  
Username (in English) : Takumi Sannomiya  
所属名 (日本語) : 東京工業大学大学院総合理工学研究科  
物質科学創造専攻  
Affiliation (in English) : Tokyo Institute of Technology,  
Dept. Innovative & Engineered Materials

※概要 (Summary) : 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

SiO<sub>2</sub>基板上に微細Agディスクパターン作製方法を  
検討している。 なし

パターン作製は孔形状のレジストでリフトオフか  
ディスク状のレジストで下のAgをエッチングする方  
法を考えているが、どちらが作りやすいか、またその  
際に必要な条件及び作業方法について相談をした。 6. 関連特許 (Patent)  
なし

同様な金属パターン作製例が開示された。  
作製方法はリフトオフが主流であるが、金属ディスク  
でなく、レジストパターンに金属蒸着して対応した例  
も示された。

相談の結果、実績のあるリフトオフで進めることし、  
実際のプロセス検討に入る。こちらの希望により

- ・EB 描画/東工大ナノプラットフォーム
- ・Ag 蒸着及びリフトオフ/ 三宮研

の分担で作業を進める。

作製パターン形状等は未定であるため、作製パターン  
検討待ち。

基本的にはAgディスクを考えるが、実験データの  
あるAuディスクの作製も考えたい。

(依頼は2016年度へ持ち越し。)

## 2. 実験 (Experimental)

技術相談のため概要のみ記載。以下空欄

## 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

技術相談のため概要のみ記載。以下空欄

## 4. その他・特記事項 (Others)

なし